Turbo Molecular Pumps Pumps Pumps Turbo Turb

株式会社 大阪真空機器製作所



「安心」「満足」「長期間使用可能」をモットーに、

事業方針

お客様のニーズを取り入れた真空システム

株式会社大阪真空機器製作所は、真空技術の国産化を目的に1950年に設立しました。以降、科学技術の進歩とお客様のニーズを取り入れた真空システムを世の中に提供することを通じて、社会への貢献を果たそうと考えてまいりました。

現在、真空技術は放射光·核融合·宇宙開発などに代表される先端の科学技術分野から、鉄鋼・繊維·化学·エレクトロニクス·半導体·FPD(ex:液晶、PDP)などの一般産業分野に至るまで、活用分野は大幅に拡大しています。

その中で大阪真空は、お客様に満足 頂く真空機器を提供するために

- ●カスタマイズ化
- ●高度安全対応
- ●未来志向
 - ●カスタマーサポート体制 を4大目標として掲げ、その具体化と より一層の深化に邁進しています。



信頼性の高い製品を提供しています。

モットー

安心して、満足して

大阪真空のモットーは「安心して、満足して、長期間使用可能な信頼性の高い製品」をお客様に提供することにあります。大阪真空が製品の信頼性に徹底的にこだわる理由は、お客様にご満足いただける製品を提供するという使命感にあります。本当の貢献とは、安心して満足して長く使っていただけること、つまり信頼性の高い堅牢な設計を土台に、お客様の期待する性能を追求し、トータルコストを安く仕上げることであると確信しております。

長期間使用可能な信頼性

大阪真空の代表的製品であるターボ 分子ポンプ(TMP)は、半導体や FPD産業で広く活用されています。 TMPは大量のガスを吸引し、用途に よっては毒性や腐食性のあるガスを吸 引し、なおかつ真空の環境を維持する という厳しい条件に耐え抜く性能を求 められています。そのような厳しいニー ズに応えるため、信頼性の高い設計・ 製作・検査と併せて、充実したメンテナ ンスサービスをご提供することにより、 長期間使用可能な製品をお届けして います。

宇宙環境の創造から、医療、半導体分野まで、

半導体製造分野

露光、描画、成膜、イオン注入、ドライエッチングなど半導体製造プロセスは高性能や耐久性を要求されます。超高真空から低真空領域の大流量排気まで、広範囲な用途に適合した製品をお届けしています。



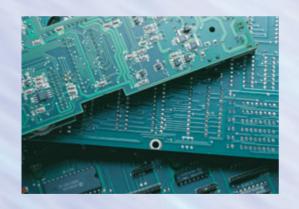
FPD製造分野

FPD(フラットパネルディスプレイ)は、大型テレビ、プロジェクター、携帯電話、カーナビゲーション、ゲーム用品など、様々な製品に使われています。またFPDも液晶・PDP・有機EL、FEDなど多くの種類があり、さらに新しい技術で新しい製品が誕生しています。当社TMPは、それぞれの製造ラインの色々なプロセスで活躍しています。



電子部品

電子部品は私たちの身の回りで多く活躍しています。ディスク、磁気ヘッド、水晶振動子、小型キャパシタや、最近ではMEMS製品や車載用機器など非常に幅広い分野の製品が存在します。当社TMPはそれらの製造過程で採用されています。





多方面で社会貢献しています。

分析・試験分野

電子顕微鏡、質量分析、分光分析、リークディテクター、宇宙環境試験など、ナノサイズの微細な情報や、はるかかなたの広大な宇宙の情報を得るため、当社TMPは活躍しています。



加速器・核融合

加速器、放射光研究、核融合研究など、各時代の世界に誇る日本の最先端技術である大型研究施設に、当社TMPが多く採用されています。当社信頼の証であるといえます。



提供:SPring-8

光学分野

レンズ、プリズム、光学フィルターなど、情報伝達製品は我々の生活の中に深く入り込んでいます。当社TMPは、その製造プロセスで最も重要な成膜プロセスに多く採用されています。



その他

管球製造用排気、電子銃排気、イオン源排 気、表面処理・改質、熱処理用排気などさま

ざまな用途 でご使用い ただいてい ます。







1971年、大阪真空機器製作所は日本で初めて



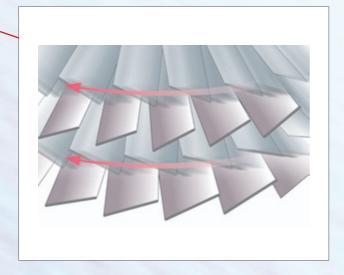


ターボ分子ポンプの開発に成功しました。

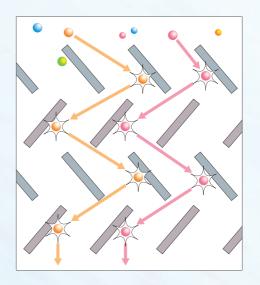
大阪真空は日本で初めてターボ分子ポンプ (TMP)の開発に成功しました。その後も市場のニーズをいち早く取り入れた製品開発をおこない、世界初の複合分子ポンプ (タービン翼+ヘリカル溝)、磁気軸受形TMP、世界最大のTMP、極高真空 (XHV)形TMP、姿勢自在形TMP (グリス潤滑: TG-F)、生成物対策TMP (断熱形構造: TG-MI)、極低振動TMP (TG-ML)など多様なラインアップを提供し続けています。また、優れた技術力と実績を背景にお客様のニーズに合わせたカスタマイズ化もおこなっています。

一般にターボ分子ポンプの構造は、その中心 にモーター体の軸があり、先端には多数の 動翼を周辺にもったロータが取り付けられています。この軸の高速回転によりロータの周速度はおおよそ300m/secにも達します。これら高速回転する多段のタービン翼が気体の排気・圧縮の仕事を行い、主に分子流領域(気体分子の平均自由行程が容器・配管の断面の最大寸法よりも十分に大きく、気体が希薄な領域)で活躍します。

大阪真空が開発した複合分子ポンプは、タービン翼の下流側に独自設計のヘリカル溝を持たせ、分子流領域のみならず、さらに気体密度の高い中間流領域でもポンプ作用を行うことができるターボ分子ポンプです。



TMPは、高速回転するタービン翼によって気体分子を排気する、機械式真空ポンプです。動翼が回転することにより、動翼段を気体分子が通過する際の輸送確率は逆方向より順方向の方が大きくなるので、気体は下流側に排気されます。また、動翼と次段の動翼の間にはケーシング側から固定翼(静翼)が挿入されています。気体分子の大部分は前段の動翼



と接しその速度を得るので、静翼に対する相対速度 を持つことになり、動翼段を通過する場合と同様の ポンプ作用が生じます。

大阪真空のTMPは、最適設計された動翼と静翼により、このポンプ作用を吸気口側から排気口側に向かって効率よく継続し、気体を排気します。



市場ニーズをいち早く取り入れた製品開発で、

姿勢自在形複合分子ポンプ

グリス潤滑玉軸受形

TG-Fシリーズ

玉軸受け方式でありながら完全取付姿勢自在です。さらに小型・軽量ですので装置レイアウトの自由度が格段に広がります。丈夫な構造が特長で、加速度に対する耐性も高く、装置全体を移動しながら運転することも可能です。また突発的な大気突入などの衝撃にも強く、従来のTMPのイメージを大きく変えました。充実した機種バリエーションで、小型から大型まで取付姿勢自在形をラインアップし



急速起動

立ち上がりが速い **TG220Fでは1-1.2分

メンテナンスフリー

グリス補給不要で、オーバーホールサイクル2~3万時間※ ※実稼働時間を1ヶ月あたり8h×20日として、約10~15年 ※実際のサイクルは、使用状況により異なります。

急速停止可能

急な圧力上昇にも耐え、リーク導入による 急速停止(一部機種)が可能

シリアル通信対応

パソコンなどによる遠隔操作が可能 **RS232C準拠シリアルインターフェイス標準装備

TMP排気ユニット

当社TMPを搭載した、汎用ターボ分子ポンプ排気ユニットです。可搬式で操作性にも優れ、保護インターロックも装備しています。メイン弁、吸入配管、真空ゲージなどのオプションも自由に追加できます。





更なる満足をお届けします。

磁気軸受形複合分子ポンプ

磁気軸受形

TG-Mシリーズ

幅広い用途に対応するため、磁気軸受形複合分子ポンプは誕生しました。磁気の力で回転体を非接触で制御することにより、取付姿勢自在、低振動、完全オイルフリーといった理想



的な真空ポンプが実現しました。また摺動部品が無くなったことでメンテナンスサイクルの長期化に結びつきました。

特殊な用途に対応した仕様

極低振動 TG-MLシリーズ

微細加工や超微小空間の 測長・分析など、最先端技 術の領域では避けたい「振 動」の影響を排除。ナノ分 野での開発に対応します。



生成物対策 TG-MIシリーズ

大阪真空独自技術の断熱 構造・自己昇温機構(特許 第3098140)を採用。ポンプ 内部の温度制御により、吸 引ガスの凝縮を軽減し、生 成物化を防ぎます。



TGkineシリーズ

幅広いプロセスに適合する バランスの良い性能を持ち、 コントローラ・電源ユニットを ポンプに一体化しました。 また、アクセス面を前面に 集中させることで、作業効 率改善、メンテナンス時の アクセス性も向上しました。



超高真空 TG-MUシリーズ

軽ガスの排気性能を向上 することにより、内部放出ガスを低減し到達圧力を向 上させました。



耐放射線仕様 TG-MRシリーズ

放射線環境下において使用するために開発されたターボ分子ポンプです。放射線に対する耐久性を高め、過酷な環境下での運転を可能にしました。





多様な製品ラインアップで、ニーズに合わせた カスタマイズ化にもお応えします。

複合分子ポンプ

油潤滑玉軸受形

TGシリーズ

軸受潤滑に油を使用しながらも接ガス部をドライに保 つ、信頼性の高いTMPです。通常使用における油の 逆拡散もありません。また潤滑油にフッ素油を

しています。







ラインアップー覧表

	ターボ分子ポンプ(複合ロータ)							
	磁気軸受形					グリス潤滑 玉軸受形	油潤滑 玉軸受形	
吸入口径	TG-Mシリーズ/TGkineシリーズ						TG-F	TGシリーズ
	標準	腐食性ガス対応	極低振動対応	反応生成物対応	超高真空形	耐放射線仕様	標準	標準/ケミカル
65A							TG50F B TG60F B TG70F B	
100A	TG390M□B	TG390M C TG420M C	TG390ML NB	TG390MI□WC TG420MI□WC			TG220F B TG240F B TG350F B	TG203 (**)
150A	TG420M B	TG900M□□C	TG900ML□NB	TG900MI⊡WC	TG900MU B	TG900MR B	TG450F□□B TG800F□□B	
200A	TG1300M□□B	TG1300M□□C	TG1300ML□NB	TG1300MI⊡WC	TG1300MU B	TG1300MR B	TG1100F B	
250A		TG2400M C TGkine220 M WC		TG2400MI WC			TG2400F B	
300A 350A		TGkine330		TGkine330 ** MI WC TGkine340 ** MI WC				TG3210 TG3410
500A	I GNITE420%MI_WD							TG5000 TG5500

※:4=排気口 40A 5=排気口 50A

(※)ケミカル形のみ

TMP型式説明

TG	220	F	*	٧	Α	В
1	2	3	4	6	6	7

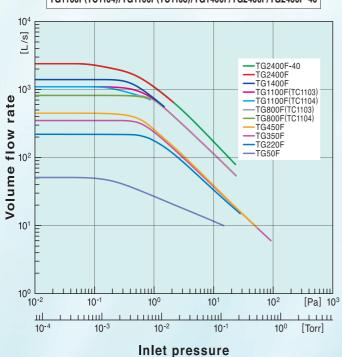
0	モデル	TG	複合分子ポンプ	
2	サイズ	おおよ	その排気速度(N2)を示す	
3		B*2	油潤滑玉軸受	
	軸受機構	F	グリス潤滑玉軸受	
		М	磁気軸受	
4		(省略)	標準形構造	
		I	断熱形構造	
	特殊構造	L	極低振動形	
		R	耐放射線形構造	
		U	超高真空形	
		С	CF	
6	吸気口	В	ISO-B	
	フランジ※1	R	ISO-R	
		٧	VG	
6		Α	強制空冷	
	冷却方式	N	自然空冷	
		W	水冷	
7		B**2	標準形	
	仕様種別	С	ケミカル形	
		Х	XHV形	
	コニヽ >**+日+/ /			

※1 フランジ規格
 CF / JVIS 003 真空装置用ベーカブルフランジ ISO-B/ISO1609:1986 真空用フランジ(ボルト固定) ISO-R/ISO1609:1986 真空用フランジ(クロー固定) VG / JISB2290:1998 真空装置用フランジ / 付属省(参考)保守用フランジ清形
 KF / ISO2861/1:1974 真空用クランブ形継手



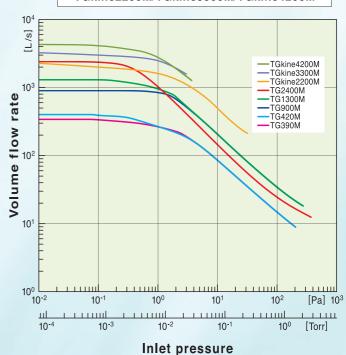
グリス潤滑玉軸受形

TG50F/TG220F/TG350F/TG450F/TG800F(TC1104)/TG800F(TC1103)/ TG1100F(TC1104)/TG1100F(TC1103)/TG1400F/TG2400F/TG2400F-40



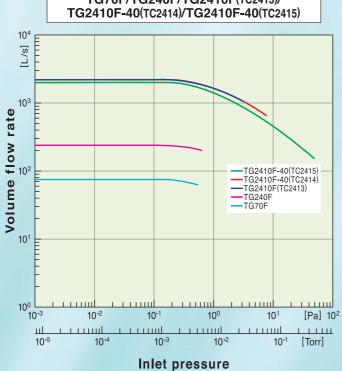
磁気軸受形

TG390M/TG420M/TG900M/TG1300M/TG2400M/ TGkine2200M/TGkine3300M/TGkine4200M



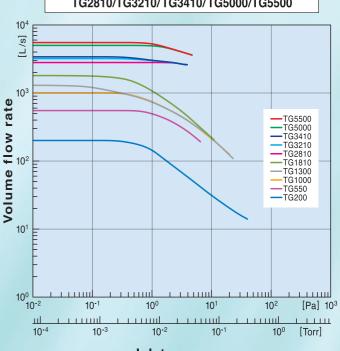
グリス潤滑玉軸受形

TG70F/TG240F/TG2410F(TC2413)/



油潤滑玉軸受形

TG200/TG550/TG1000/TG1300/TG1810/ TG2810/TG3210/TG3410/TG5000/TG5500





お客様が求めるニーズを的確に受け止め、

TMPを適正に選定いただくために

すべての分子には、固有の平均自由行程が存在します。この平均自由行程は、圧力により大きく変化します。例えば、空気の平均自由行程は大気圧下ではわずか約 0.05μ mですが、1Paでは約5mm、1×10⁵Paでは何と500mにも達します。ターボ分子ポンプは、それらの

分子を機械的な運動により捕まえてダイナミックな排気を可能にする優秀な真空ポンプです。大阪真空は、お客様によりご満足いただくため、ご使用目的に合わせて適切なターボ分子ポンプを選定いただけるよう幅広いラインアップを揃えています。

用途によって異なるポンプ選定

ターボ分子ポンプの用途は大きく分けて2つあります。まずひとつは高真空領域を達成するためのポンプです。高真空下(特に分子流領域)では、気体分子は各々が衝突するより先に、容器内壁に衝突している状態です。この状態では、容器内で飛び交う分子の数よりも、容器内壁や内部機器類から放出される分子の数や、内部へ透過する分子の数の方が圧倒的に多いため、被排気容器や内部機器類の表面積の計算が必要になります。

もうひとつは、真空中でさまざまな処理を行う場合に、大量に流すプロセスガスを排気する用途です。その場合、それぞれのガスが持つ特性(分子量、粘性、腐食性など)を考慮したポンプの選定が必須となります。

さらに容器と真空ポンプをつなぐ配管のサイズ、 形状によってコンダクタンス(流れやすさの値) が大きく影響を受けます。

ポンプ選定には、用途や排気系のレイアウトが 非常に重要なポイントとなります。





最適なTMP選定をお手伝いします。

TMP吸気ロフランジ ()mextion はどのような種類が ありますか?

VGフランジ(Oリング)、ISOフラン ジ(センターリング)、CFフランジ (銅ガスケット)などがあります。チャン バー等の接続口形状にあわせて選定 してください。なお、各機種により異なり ますので、詳しくは各カタログをご覧くだ

補助ポンプの 選定は どうすればよいですか?

さい。

各カタログの仕様欄に記載してい る「推奨基準補助ポンプ」を参照 してください。

Onestion

腐食性ガスの 排気はできますか?

はい、内部表面処理やガスパージ 機構を搭載したケミカル形で排気 できます。ただし、ガス種によっては排 気できない場合もあるので、詳しくは当 社までお問い合わせください。

含むガスは 排気できますか?

はい、対応機種があります。詳しく は当社までお問い合わせください。

補助ポンプとの 同時起動は できますか?

はい、排気条件によっては可能で す。チャンバー等が排気系に対し て非常に大きい場合(TMPの起動時 間内に、補助ポンプだけで許容最大排 気口圧力以下に圧力が下がらない場 合)はまず補助ポンプのみによる粗引き が必要ですが、そうでない場合は、補 助ポンプの起動と同時にTMPを起動 させることができます。

遠隔操作は できますか?

はい、できます。パワーサプライ(コ ントローラ)にはシリアル通信コネク タ及びリモートコネクタを用意していま す。リモートコネクタによって制御盤から コントロールする他、シリアル通信コネク タ(RS232C準拠)によってパソコンなど からのコントロールも可能です。

※パワーサプライにはコネクタのみ付属していますので、 ケーブルは別途ご用意ください。

電圧低下、停電の時は () maxim どうなりますか?

ある程度の時間内(~3秒、機種 により異なります)であれば、その まま稼働状態を続けます。それ以上の 電圧低下、停電時には、自動的にブレー キ動作状態に入ります(磁気軸受形以 外のTMPではフリーラン停止します)。

Luestion

12

ガリウム(Ga)を



充実したサポート体制によって、世界のお客様を

大阪真空はお客様のパートナーとして、真空に関する相談から、ニーズに合わせた真空システムのご提案、 アフターサービスまで、お客様をトータルサポートいたします。

大阪真空は、サポート体制の拡充に向けて、特に海外サポート拠点の整備を推進中です。U.S.A./カリフォル ニア州、韓国/京畿道城南市、中国/上海市には直営施設を、台湾、韓国、U.S.A.、ヨーロッパ、東南アジアには 信頼のおける提携会社を通じて、質の高いサポートを提供いたします。このように日本、韓国、台湾、中国、 U.S.A.など、お客様が世界中どこでも安心して製品が使用できるよう、サポート体制の拡大と充実につとめて

日本

■大阪本社

〒541-0042 大阪市中央区今橋3-3-13 Tel.06-6203-3981 Fax.06-6222-3645

〒104-0061 東京都中央区銀座8-14-14 Tel.03-3546-3731 Fax.03-3546-1560

■名古屋営業所 🔐 🚰 🚐 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-18-1 Tel.052-950-3051 Fax.052-950-3062

■名張工場

〒518-0605 三重県名張市八幡1300-81 Tel.0595-64-1161 Fax.0595-64-1166

■堺工場 〒593-8324 大阪府堺市西区鳳東町7-775 Tel.072-271-1881 Fax.072-273-7433

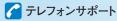


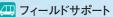


Osaka Vacuum, Ltd.

拠点紹介













アジア

■上海事務所



Level 23 Citigroup Tower, 33 Hua Yuan Shi Qiao Rd., Lu Jia Zui, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86-21-6101-0360 Fax: +86-21-6101-0110



Leaders Bldg., 274-4, Seohyun-Dong, Bundang-Ku, Seongnam, Gyeonggi-Do 463-824, Korea Tel. +82-31-707-0002 Fax. +82-31-707-3339

トータルサポートします。

〈関係会社〉

■上海欧洒卡真空機器有限公司(中国) 🚰 🕮 💙 South A, T52-4-1F, No.1510, Chuanqiao Rd., Pudong, Shanghai 201206, P.R. China Tel. +86-21-5031-1522 Fax. +86-21-5031-1523

〈修理・サービス代理店〉

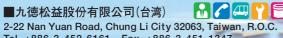




#12LT 36BI Namdong-Industry Area, Namdong-ku, Inchon 405-100, Korea

Tel. +82-32-814-6331 Fax. +82-32-814-7301

〈販売代理店/修理・サービス代理店〉



U.S.A.

〈関係会社〉

■Osaka Vacuum U.S.A., Inc. 48000 Fremont Blvd., Fremont, CA 94538, U.S.A. Tel. +1-510-770-0100 Fax. +1-510-770-0104

〈修理・サービス代理店〉

■Ebara Technologies Inc. 51 Main Avenue, Sacramento, CA 95838, U.S.A. Tel. +1-916-920-5451 Fax. +1-916-830-1900

Europe

〈修理・サービス代理店〉

EBARA Precision Machinery Europe GmBH M C ... 2 Cochrane Square Brucefield Industrial Estate Livingston EH54 9DR, UK Tel. +44 (0) 1506 460232 Fax. +44 (0) 1506 460222





安全にお使いいただくために本カタログに記載された製品を正しくお使いいただくため、で使用の前に必ず取扱説明書をよくお読み下さい。

注意事項:「外国為替及び外国貿易法」に定める規制貨物に該当する場合には、同法に基づく許可を要することがあります。



URL http://www.osakavacuum.co.jp e-mail info@osakavacuum.co.jp

株式会社 大阪真空機器製作所

■ 西日本営業部 〒541-0042 大阪市中央区今橋3-3-13

Tel (06) 6203-3981 Fax (06) 6222-3645

■ 名張工場 ■ 堺工場

■ 東日本営業部 〒104-0061 東京都中央区銀座8-14-14

Tel (03) 3546-3731 Fax (03) 3546-1560

■ ソウル支店

■ 名古屋営業部 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-18-1

Tel (052) 950-3051 Fax (052) 950-3062

■ 上海事務所

関連 会社 上海欧洒卡真空機器有限公司 Osaka Vacuum U.S.A., Inc.

South A, T52-4-1F, No. 1510, Chuanqiao Rd., Pudong, Shanghai 201206, P.R. China

Tel: +86-21-5031-1522 Fax: +86-21-5031-1523

48000 Fremont Blvd., Fremont, CA 94538, U.S.A.

Tel: +1-510-770-0100 Fax: +1-510-770-0104

ISO9001







大阪真空の製品群

ターボ分子ポンプ・複合分子ポンプ・磁気軸受形ターボ分子ポンプ・ 磁気軸受形複合分子ポンプ・ヘリカル溝真空ポンプ・ ターボ分子ポンプ排気ユニット・ドライ真空ポンプ・油回転真空ポンプ・ ルーツ真空ポンプ・液封式真空ポンプ・油拡散真空ポンプ・エジェクタ・ 真空システム・真空装置・真空バルブ・真空部品

本カタログに記載の事項を無断で転載することはご遠慮ください。通告なしに記載事項を変更することがあります。